Сонохімічний синтез частинок діоксиду кремнію із карбіду кремнію у водному розчині

М. Закіров*, О. Коротченков, Я. Рибак

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна

(Одержано 30.06.2016, опубліковано online 29.11.2016)

У роботі запропоновано новий метод отримання нанорозмірних частинок SiO2 шляхом сонохімічної реакції у суміші SiC в дистильованій воді. Спектри FTIR виявляють піки поглинання, характерні для різних мод коливання в аморфному SiO_x. Аналіз спектру оптичного пропускання дозволив встановити наявність трьох провалів у спектрі із енергіями 2.9, 3.6 та 4.1 еВ, що можна пов'язати із кисневими центрами та піроксидними радикалами ≡Si-O-O•; смугою, що реалізується у ланцюжку ≡Si-O-O-Si≡ та точковими дефектами в ≡Si-O-Si=, відповідно.

Ключові слова: Сонохімічна реакція, Діоксид кремнію, Спектроскопія FTIR.

DOI: 10.21272/jnep.8(4(1)).04002

PACS numbers: 81.05.Gc, 61.46.Hk, 81.07.Wx, 81.16.Be, 43.35.Vz

1. ВСТУП

Оксиди металів відіграють важливу роль у різноманітних сферах фізики, хімії, матеріалознавства. Оксиди металів використовуються для виготовлення сенсорів, п'єзоелектричним елементів, елементів живлення, а також для покриття та пасивації поверхні та каталізу [1]. Як наслідок, оксиди перехідних металів знайшли широке використання у магнетоелектроніці, фото- та сонячних елементах, газових сенсорах.

Діоксид кремнію є предметом інтенсивних досліджень, що викликано його фізико-хімічними властивостями. Діоксид кремнію існує у різноманітних кристалічних формах: найбільш вивченій – кварц, кристобалит, тридимит, стишовит і коесит, проте найбільш розповсюджений аморфний діоксид кремнію. Властивості діоксиду кремнію змінюються в залежності від його чистоти, форми, розміру, розподілу за розмірами частинок, сформованих переходів [2-9].

Діоксид кремнію може биту отриманий різними методами: золь-гель [10], осадження із рідкої фази [11], напилення та осадження із газової фази [12]. Особливий інтерес спрямований на синтез кристалічного та однорідного матеріалу для застосування в мікроелектроніці, оптичних, електричних областях. Золь-гель метод продемонстрував гнучкість шляху синтезу, а також можливість отримання різноманітних конфігурацій, таких як монолітні блоки, покриття, волокна та плівки для застосування в оптичних приладах. Сіль металу піддається гідролізу та реакції поліконденсації з утворенням гелеподібної колоїдної суспензії, що складається із розчинника та твердої фази оксиду металу, морфологію якого можна змінювати від дискретних частинок до неперервних полімерних сіток [13]. До переваг золь-гель методу відносять можливість контролювання розмірів та дисперсії частинок при низьких температурах.

Нанорозмірні частинки діоксиду кремнію із високою питомою поверхнею були отримані із використанням розчину силікату натрію у воді та хлороводню [14]. Більшість методів синтезу нанорозмірного діоксиду кремнію та структур на основі діоксиду кремнію базуються на гідрозілі тетраетилортосилікату (TEOC) [15]. У загальному випадку отримання діоксиду кремнію із TEOC складається із двох кроків: гідроліз TEOC із формуванням кремнієвих кислот, та конденсація у результаті розкладу кремнієвих кислот. Синтез діоксиду кремнію можна представити у наступному вигляді [16, 17]:

 $Si(OR)_4 + 4H_2O \rightarrow Si(OH)_4 + 4ROH$ (гідроліз)

 $Si(OH)_4 \rightarrow SiO_2 + 4H_2O$ (конденсація)

Одним і методів отримання низькорозмірних напівпровідникових кристалів виступає сонохімічний синтез. В основі сонохімічного методу синтезу напівпровідникових кристалі лежить явище кавітації. При колапсі «гарячої бульбашки» досягаються температури 5000К та тиски у 1000 атм [18-21].

Дана робота присвячена першій демонстрації можливості отримання частинок SiO₂ сонохімічним методом.

2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Для синтезу діоксиду кремнію в даній роботі використовувались карбід кремнію SiC (техн. > 98 % F150 розмір зерна ~ 100 мкм) та дистильована вода.

Синтез здійснювався з використанням сонохімічної реакції, для проведення якої 40 мл дистильованої води поміщалось у сонохімічний реактор. Після цього у сонохімічний реактор вводилось 1 г карбіду кремнію. Частота опромінення (25-30 кГц) підбиралась та регулювалась для отримання кавітації у хімічному розчині. Сонохімічна реакція протікала на протязі 120 хв. Після цього реакційна суміш переміщувалась із сонохімічного реактора. Осад карбіду кремнію, що не вступив у сонохімічну реакцію, відділявся від розчину діоксиду кремнію седементаціею. У загальному випадку реакцію отримання діоксиду кремнію можна записати у наступному вигляді:

 $SiC + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + CH_4 + H_2.$

^{*} zakyrov@gmail.com

М. Закіров, О. Коротченков, Я. Рибак

Механізм формування діоксиду кремнію в такій сонохімічній реакції ілюструється на рис. 1.

Хімічний склад синтезованого діоксиду кремнію аналізувався з використанням методу інфрачервоної (IЧ)-спектроскопії. Спектри IЧ поглинання досліджувались у діапазоні 400-4000 см⁻¹ на спектрометрі Spectrum BX-II FTIR Perkin Elmer. При цьому синтезований діоксид кремнію висушувався та досліджувався у формі порошку. Спектри оптичного поглинання реєструвались за допомогою монохроматора МДР-23 та водневої лампи в якості джерела світла. Оптичне поглинання реєструвалось без додаткової обробки отриманого розчину частинок діоксиду кремнію у воді.



Рис. 1 – Механізм росту кристалів діоксиду кремнію при сонохімічній реакції

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Типовий спектр IЧ-пропускання синтезованого діоксиду кремнію наведено на рис. 2. Зареєстровані піки FTIR добре узгоджуються із результатами попередніх досліджень SiO₂ [10, 22-25], а також виявляють присутність залишку карбіду кремнію, що не вступив у хімічну реакцію.



Рис. 2 – Спектр IЧ пропускання сонохімічно синтезованого зразку діоксиду кремнію

Пік на 454 см⁻¹ із вібраційним розтягом Si-O-Si спостерігався у аморфному SiO_x. Піки на 822 см⁻¹ та 934 см⁻¹ відносяться відповідно до коливань у Si-O-

Si та вібраційного розтягу Si-C зв'язків у кристалічній фазі карбіду кремнію.



Рис. 3 – Виділення коливальних смуг діоксиду кремнію та карбіду кремнію (лінії) із фрагменту спектру FTIR на рис. 2 (пунктир)

Смуга в спектральній області 1050-1300 см⁻¹ більш детально розгорнута на рис. 3 (пунктирна лінія). Очевидно, що ця смуга формується накладанням двох коливальних мод, асиметричним розтягом у Si-O-Si та розтягом у Si-O-C із відповідними піками на 1094 см⁻¹ та 1146 см⁻¹ (суцільні лінії на рис. 3).

Смуга спектру FTIR, поданого на рис. 2, із максимумом на 2356 см⁻¹ у літературі співвідноситься із коливаннями розтягу у карбіді кремнію. Піки на 1405 см $^{-1}$, 1632 см $^{-1}$, 2922 см $^{-1}$ та 3442 см $^{-1}$ пов'язуються із коливанням С=О, С-О, О-Н, С-Н_x та О-Н, відповідно. Очевидно, що дані моди коливань утворились внаслідок абсорбції відповідних молекулярних сполук на поверхні синтезованого зразку. На рис. 4 схематично представлено структуру синтезованого зразку із зазначеними абсорбованими сполуками. Також на рис. 4 наведено відповідні значення максимумів піків, представлених у спектрі FTIR на рис. 2, та вказано комплекс, що формує певну моду коливання. Таким чином, дані рис. 2-4 підтверджують формування діоксиду кремнію у запропонованому в даній роботі сонохімічному синтезі.



Рис. 4 – Схематичне представлення синтезованого зразку SiO₂ із абсорбованими сполуками та представленням відповідних мод коливань

Сонохімічний синтез частинок діоксиду кремнію...

Рис. 5 – Спектр оптичного пропускання синтезованого діоксиду кремнію у розчині води

Згідно літературних даних, для карбіду кремнію пирина забороненої зони становить 2.3-2.4 eB (політип 3C-SiC) [26], 3.0-3.3 eB (4H-SiC та 2H-SiC) [27, 28], 3.0 eB (6H-SiC) [29]. Для діоксиду кремнію, ширина забороненої зони становить 7.8-9 eB [30, 31]. Однак, у діоксиді кремнію також проявляються піки поглинання у діапазоні 1.6-7.7 eB [32-34], що реалізуються за рахунок різноманітних комплексів об'ємних та поверхневих дефектів. Також для нанорозмірного діоксиду кремнію спостерігається залежність положення зазначених піків від розмірів частинки [33].

Ж. нано- електрон. ФІЗ. 8, 04002 (2016)

На рис. 5 наведено спектр оптичного пропускання синтезованого зразку у діапазоні 4.5-2 еВ. Видно, що спостерігаються три основних смуги на 2.9 еВ, 3.6 eB та 4.1 eB. Смугу біля 4.1 eB співвідносять із кисцентрами (non-bridging oxygen невими hole center) [35], а також із піроксидними радикалами ≡Si-O-O• [36]. Смугу на 3.6 eВ можна співставити із відомою смугою, що реалізується у ланцюжку ≡Si-O-О-Si≡ [32]. Смуга на 2.9 eВ може бути пов'язана із точковими дефектами в зв'язаних парах атомів Si (point defects in dicoordinated silicon lone pair, ≡Si–O– Si-O-Si≡) [33, 35]. Відзначимо, що саме за рахунок поглинання у цих смугах формується спектри фотолюмінесценції нанорозмірного діоксиду кремнію у видимому діапазоні [35].

Таким чином, в роботі вперше показана можливість отримання частинок SiO_2 сонохімічним методом використовуючи у якості прекурсору карбід кремнію. Молекулярну структуру синтезованого діоксиду кремнію підтверджує отриманий спектр інфрачервоного поглинання. Найінтенсивніші моди коливань відповідають коливанням Si–O–Si у аморфному SiOx, Si–O–Si та Si–C у кристалічній фазі карбіду кремнію відповідно, асиметричним розтягом у Si–O–Si та розтягом у Si–O–C.

Сонохимический синтез частиц диоксида кремния из SiC в водном растворе

М. Закиров, О. Коротченков, Я. Рыбак

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, физический факультет, ул. Владимирская, 64/13, 01601 Киев, Украина

В работе предложен новый метод получения наноразмерных частиц SiO2 с помощью сонохимической реакции в смеси SiC в дистиллированной воде. Спектры FTIR обнаруживают пики поглощения, характерные для разных мод колебания в аморфном SiO_x. Анализ спектров оптического поглощения позволил выявить три характерных провала с энергиями 2.9, 3.6 и 4.1 эВ, что можно связать с кислородными центрами и пироксидными радикалами ≡Si-O-O•; полосой что реализуется в ≡Si-O-O-Si≡ и точечными дефектами в ≡Si-O-Si=, соответственно.

Ключевые слова: Сонохимическая реакция, Диоксид кремния, Спектроскопия FTIR.

Sonochemical Synthesis of the Silica Particles from SiC in Water Solution

M. Zakirov, O. Korotchenkov, Ya. Rybak

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13, Volodymyrska st., 01601 Kyiv, Ukraine

The paper presents a new method of producing nanosized SiO_2 particles by a sonochemical reaction in a mixture of SiC in distilled water. FTIR spectra exhibit absorption peaks characteristic of different modes of oscillation in the amorphous SiO_x . Optical transmittance spectra demonstrate three characteristics components with energies of 2.9, 3.6 and 4.1 eV, which correspond to non-bridging oxygen hole center and \equiv Si-O-O'; band at 3.6 eV associated to chain \equiv Si-O-O-Si \equiv and point defects in dicoordinated silicon lone pair, \equiv Si-O-Si \equiv , respectively.

Keywords: Sonochemical reaction, Silicon dioxide, FTIR spectroscopy.

М. Закіров, О. Коротченков, Я. Рибак

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- H. Li, L. Guan, Z. Xu, Y. Zhao, J. Sun, J. Wu, and N. Xu, *Appl. Surf. Sci.* 389, 705 (2016).
- 2. L. Tang, J. Cheng, Nano Today 8, 290 (2013).
- N. Cheng, P. Liu, S. Bai, Z. Yu, W. Liu, S.-S. Guo, X.-Z. Zhao, *J. Power Sources* 321, 71 (2016).
- Ü.Ö. Akkaya Arıer, Int. J. Light Electron Opt. 127, 6439 (2016).
- 5. S. Mou, Y. Lu, Y. Jiang, Appl. Surf. Sci. 384, 258 (2016).
- A. Khaloo, M.H. Mobini, P. Hosseini, *Constr. Build. Mater.* 113, 188 (2016).
- X. Yuan, L. Cheng, Y. Zhang, S. Guo, L. Zhang, *Mater. Des.* 92, 563 (2016).
- X. Yuan, L. Cheng, L. Zhang, J. Alloy. Compd. 680, 604 (2016).
- W. Walke, Z. Paszenda, T. Pustelny, Z. Opilski, S. Drewniak, M. Kościelniak-Ziemniak, M. Basiaga, *Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl.* 63, 155 (2016).
- M. Houng, Y. Wang, C. Huang, S. Huang, J.-H. Horng, Solid. State. Electron. 44, 1917 (2000).
- J. Pérez-Bueno, R. Ramírez-Bon, Y. Vorobiev, F. Espinoza-Beltrán, J. González-Hernández, *Thin Solid Films* **379**, 57 (2000).
- V. Bhatt, S. Chandra, J. Micromechan. Microengineering 17, 1066 (2007).
- I.A. Rahman, V. Padavettan, J. Nanomater. 2012, 132424 (2012).
- 14. S. Ui, S. Lim, J. Cermic Process. Res. 10, 4 (2009).
- S. Zheng, C. Shen, M. Alunbate, J. Deng, L. Wang, Z. Han, H. Tang, *Prog. Org. Coatings* **76**, 425 (2013).
- K.S. Rao, K. El-Hami, T. Kodaki, K. Matsushige, K. Makino, J. Colloid Interface Sci. 289, 125 (2005).
- S.K. Park, K.Do. Kim, H.T. Kim, Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 197, 7 (2002).
- 18. K.S. Suslick, *Faraday Discuss.* 170, 411 (2014).
- Y.L. Pang, A.Z. Abdullah, S. Bhatia, *Desalination* 277, 1 (2011).
- 20. J. Zhu, Y. Koltypin, A. Gedanken, *Chem. Mater.* **12**, 73 (2000).

- P. Mishra, R.S. Yadav, A.C. Pandey, Ultrason.-Sonochemistry 17, 560 (2010).
- 22. X.Le Guével, B. Hötzer, G. Jung, M. Schneider, J. Mater. Chem. 21, 2974 (2011).
- W. Tansub, K. Tuitemwong, P. Limsuwan, S. Theparoonrat, P. Tuitemwong, J. Nanomater. 2012, 865186 (2012).
- 24. J.-D. Brassard, D. K. Sarkar, J. Perron, Appl. Sci. 2, 453 (2012).
- 25. C. Jiang, Y. Zhang, Q. Wang, T. Wang, J. Appl. Polym. Sci. 129, 2959 (2013).
- 26. J. López-Vidrier, P. Löper, M. Schnabel, S. Hernández, M. Canino, C. Summonte, S. Janz, B. Garrido, *Sol. Energy Mater. Sol. C.* 144, 551 (2016).
- 27. W. Li, J. Zhao, D. Wang, Solid State Commun. 205, 28 (2015).
- Y. Zhang, N. Lin, Y. Li, X. Wang, H. Wang, J. Kang, R. Wilks, M. Bär, R. Mu, *Sci. Rep.* 6, 23106 (2016).
- B. Adeli, F. Taghipour, ECS J. Solid State Sci. Technol. 2, Q118 (2013).
- J.S. Sanjeev Kumar Gupta, J.A. Sanjeev Kumar Gupta, *Physics and Technology of Silicon Carbide Devices* (InTech, 2012).
- R.J. Trew, Handbook of RF and Microwave Power Amplifiers (Cambridge University Press, Cambridge, 2011).
- 32. C. Anastasescu, M. Zaharescu, D. Angelescu, C. Munteanu, V. Bratan, T. Spataru, C. Negrila, N. Spataru, I. Balint, *Sol. Energ. Mat. Sol. C.* **159**, 325 (2017).
- I.A. Rahman, P. Vejayakumaran, C.S. Sipaut, J. Ismail, C.K. Chee, *Mater. Chem. Phys.* 114, 328 (2009).
- 34. M. Jafarzadeh, I.A. Rahman, C.S. Sipaut, *Ceram. Int.* 36, 333 (2010).
- 35. A.-M. El-Sayed, K. Tanimura, A.L. Shluger, J. Phys. Condens. Matter 27, 265501 (2015).